

497413-2026 - Kilpailu

Saksa – Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) – Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

OJ S 136/2026 17/07/2026

Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä

Tavarahankinnat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Sähköposti: wahl@ifos.uni-kl.de

Ostajan oikeudellinen muoto: Hankintaviranomaisen subventoiman sopimuksen tekevä organisaatio

Pääasiallinen toimiala: Koulutus

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Kuvaus: Los1: DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los1.25-1696.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los1.25-1696.06.Wertungsmatrix". Los2: Transmissionselektronenmikroskop (TEM) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Transmissionselektronenmikroskops (TEM) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los2.25-1707.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los2.25-1707.06.Wertungsmatrix".

Menettelyn tunniste: b3e6743d-bfc2-4cac-a001-90b28790bddb

Sisäisen tunniste: 25-1696-1707

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

Menettelyn tärkeimmät piirteet: Die Vergabe erfolgt in zwei Losen (Los 1: FIB, Los 2: TEM).

Bieter, die Angebote für beide Lose abgeben, können zusätzlich ein Gesamtangebot (Kombinationsangebot) einreichen. Das Kombinationsangebot muss auf den angebotenen Einzel-Angeboten zu beiden Losen basieren; der Leistungsumfang des Kombinationsangebotes muss den Leistungsumfängen der Angebote auf die Einzellöse entsprechen. Das Kombinationsangebot ist zusätzlich zu den losweisen Angeboten einzureichen und muss: - einen gesonderten Gesamtpreis für beide Lose (unter Berücksichtigung etwaiger Preisvorteile, z. B. Rabatte), sowie - eine Darstellung eines etwaigen losübergreifenden wissenschaftlichen, technischen, funktionalen oder organisatorischen Mehrwerts einer gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform enthalten. Etwaige Preisvorteile werden ausschließlich im Zuschlagskriterium "Preis" berücksichtigt. Ein losübergreifender Mehrwert wird ausschließlich im Zuschlagskriterium

"Technik" bewertet und setzt voraus, dass dieser über die Bewertung der Einzellose hinausgeht und sich aus dem Zusammenwirken beider Systeme ergibt. Die Bewertung der Kombinationsangebote erfolgt nach denselben Zuschlagskriterien. Zusätzlich werden losübergreifende Aspekte wie die vollständige wissenschaftliche Prozesskette einer Probe - von der Präparation im FIB über den qualitätserhaltenden Proben transfer und die korrelative Untersuchung im TEM bis hin zum gemeinsamen Datenmanagement und der nachvollziehbaren Dokumentation der Untersuchungsergebnisse berücksichtigt. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag entweder losweise oder losübergreifend zu erteilen.

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)

2.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Maa: Saksa

2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DNMMUBY#

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

vgv -

2.1.5. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Osien enimmäismäärä, joiden osalta yksi tarjoaja voi jättää tarjouksia: 2

Sopimusehdot:

Osien enimmäismäärä, joista voidaan tehdä sopimus yhden tarjoajan kanssa: 2

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus

Puhtaasti kansallisten poissulkemisperusteiden nojalla asetettujen velvoitteiden rikkominen:

Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen:

Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset:

Rahanpesu tai terrorismin rahoitus:

Petos:

Korruptio:

Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot:

Verojen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen:

Sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen:

Ympäristölainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen:

Sosiaalilainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen:

Työlainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen:

Maksukyvyttömyys:

Varat selvitysmiehen hallinnassa:

Liiketoiminta on keskeytetty:

Kansallisesta lainsäädännöstä johtuva konkurssia tai muuta sellaista vastaava tilanne:

Ammatin harjoittamiseen liittyvä vakava virhe:

Toisten talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi tehdyt sopimukset:

Talouden toimijan hankintamenettelyyn osallistumisesta johtuvat eturistiriidat:

Välitön tai välillinen osallistuminen tämän hankintamenettelyn valmisteluun:
Ennenaikainen irtisanominen, vahingonkorvaukset tai muut vastaavat seuraamukset:
Väärien tietojen antaminen, tietojen salaaminen, vaadittujen asiakirjojen toimittamatta jättäminen tai tätä menettelyä koskevien luottamuksellisten tietojen saaminen:

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB)

Kuvas: Ziel dieses Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Dual-Beam-FIB/REM-Systems (Focused Ion Beam / Rasterelektronenmikroskop) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient primär der präzisen Probenpräparation (u.a. TEM-Lamellen, APT-Spitzen, Querschnitte und Defektfreilegungen) und sekundär der hochauflösenden bildgebenden, chemischen und strukturellen Charakterisierung (SEM, EDX, STEM, EBSD) im selben System. Das Gerät wird als zentrale Präparations- und Analyseplattform für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Typische Anwendungen umfassen u. a. Batterie- und Elektrodenmaterialien, Wasserstoffspeichermaterialien, katalytische Schichten, Metalle/Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen und Multilayer-Systeme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - reproduzierbarer, möglichst automatisierter TEM-Lamellen- und APT-Präparation (Lift-Out, Thinning, Polishing) - 3D-Analytik (Serienschliff/Tomographie) mit quantitativer Auswertung - hochaufgelöster Abbildung in verschiedenen SEM-Modi incl. Ioneninduzierter Sekundärionen sowie korrelierter Bildgebung während der Bearbeitung - chemischer Analytik mittels EDX und kristallographischer Analytik mittels EBSD Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die präzise Probenpräparation und -strukturierung mittels Ionenstrahl sowie die begleitende und nachfolgende Abbildung und Analytik mittels SEM und anderen Detektorsystemen ermöglichen. Ziel ist die reproduzierbare Präparation von Proben für TEM und APT sowie die Durchführung von 2D/3D-Analysen (Bildgebung (SE, STEM), EDX, EBSD) einschließlich vollständiger Dokumentation der Bearbeitungs- und Messparameter. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Materialabtrag/Strukturierung (manuell und automatisiert) mit definierbaren Pattern- und Rezeptfunktionen. 2. TEM-Lamellenpräparation inkl. In-situ Lift-Out, Thinning und abschließender Feinpolitur. 3. APT-Spitzenpräparation (Needle Milling) inkl. reproduzierbarer Geometrie. 4. Korrelierte Echtzeit-Bildgebung im SEM während der FIB-Bearbeitung (Navigation/Endpunktkontrolle). 5. Chemische Analytik mittels EDX sowie kristallographische Analytik mittels EBSD (Punkt, Linie, Mapping). 6. 3D-Workflows (Serienschliff/Tomographie) mit dokumentierter Rekonstruktion bzw. Export der Datensätze. 7. Workflow und Datenmanagement: eindeutige Zuordnung von Bearbeitungs-/Messdaten, Parametern und Metadaten; Export in nicht proprietäre Formate.

Sisäinien tunniste: 1

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)

5.1.2. Suorituspaikka

5.1.3. Arvioitu kesto

Muu kesto: Tuntematon

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Ei tarpeen

Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus

Kriteeri: Viitteet määritelyihin toimituksiin

Valintaperusteen kuvaus: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Preis (Angebote auf Einzellöse und Kombinationsangebote)

Kuvaus: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewichteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewichteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewichteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 50

Kriteeri:

Tyyppi: Laatu

Nimi: Technik (Angebote auf Einzellöse bzw. Kombinationsangebote)

Kuvaus: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet.

Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf."
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 50

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>

Tilapäinen viestintäkanava:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 77 Päivät

Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen :

Hankkijan hankinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.

Lisätiedot: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sähköinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Tietoa muutoksenhaun määraajista: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

5.1. Osa: LOT-0002

Ilmoituksen nimi: Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Kuvas: Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines aberrationskorrigierten 200 kV Transmissionselektronenmikroskops (S/TEM) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient als zentrale Analyseplattform für die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Charakterisierung von Materialien auf atomarer und nanometergenauer Skala. Es wird sowohl für industrielle Auftragsanalytik als auch für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Im Institut werden Materialien mit stark variierenden Eigenschaften untersucht, insbesondere Metalle, Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen, funktionale Schichtsysteme sowie nanostrukturierte Materialien. Die Proben unterscheiden sich hinsichtlich Geometrie, Stabilität gegenüber Elektronenstrahlbelastung sowie analytischer Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - hochauflösender Abbildung bis in den atomaren Bereich - chemischer Analytik mittels EDX und EELS - Untersuchung von Grenzflächen und Defekten - Untersuchung magnetischer und funktionaler Materialien - reproduzierbaren Messungen über Probenserien hinweg Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Analyse von festen, elektronenstrahlstabilen Proben im Transmissionselektronenmikroskopie- und Raster-Transmissionselektronenmikroskopie-Modus ermöglichen. Hierzu muss es eine präzise

Elektronenoptik, stabile Betriebsbedingungen sowie integrierte analytische Detektionssysteme bereitstellen. Ziel ist die Untersuchung von Materialien bis in den atomaren Maßstab sowie die quantitative und qualitative Analyse von Struktur, Zusammensetzung und elektronischen Eigenschaften. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Hochauflösende Abbildung (TEM und STEM): - Abbildung von Kristallstrukturen, Defekten, Grenzflächen und Nanostrukturen mit atomarer bzw. sub-nanometergenauer Auflösung. - Betrieb sowohl im konventionellen TEM- als auch im STEM-Modus. - Flexible Wahl geeigneter Abbildungsmodi (z. B. Bright Field, Dark Field, HAADF, ABF, Oberflächenbildgebung mit topografieabhängigem Kontrast). 2. Chemische und spektroskopische Analytik: - Elementanalytik mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX). - Analyse elektronischer und chemischer Zustände mittels Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS). - Durchführung von Punktanalysen, Linienprofilen sowie zweidimensionalem Mapping. 3. Untersuchung von Grenzflächen und Defekten: - Analyse von Phasengrenzen, Ausscheidungen, Korngrenzen und strukturellen Inhomogenitäten. - Untersuchung lokaler chemischer Variationen auf nanoskaliger Ebene. 4. Untersuchung funktionaler und magnetischer Materialien: - Möglichkeit zur magnetfeldfreien oder feldarmen Abbildung (z. B. Lorentz-Modus oder funktional gleichwertig), soweit erforderlich. 5. Automatisierter und reproduzierbarer Betrieb: - Reproduzierbare Einstellung von Messparametern und Speicherung von Messabläufen. - Unterstützung automatisierter Messreihen und Mapping-Experimente. 6. Workflow und Datenmanagement: - Eindeutige Zuordnung von Messdaten, Parametern und Metadaten. - Möglichkeit zur späteren Reproduktion von Messbedingungen. 7. Integration aller Detektoren und Betriebsmodi in eine konsistente Bedienumgebung.

Sisäinen tunniste: 2

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto

Muu kesto: Tunteamaton

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Ei tarpeen

Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus

Kriteeri: Viitteet määriteltäisiin toimituksiin

Valintaperusteiden kuvaus: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)

Kuvaus: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewichteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewichteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewichteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteiden luku: 50

Kriteeri:

Tyyppi: Laatu

Nimi: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)

Kuvaus: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet. Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf."

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteiden luku: 50

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>

Tilapäinen viestintäkanava:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 77 Päivät

Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen :

Hankkijan hankinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.

Lisätiedot: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sähköinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,

einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Rekisterinumero: UStID DE148647541

Postiosoite: Trippstadter Straße 120

Postitoimipaikka: Kaiserslautern

Postinumero: 67663

Maaryhmittely (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Maa: Saksa

Sähköposti: wahl@ifos.uni-kl.de

Puhelin: +49 631205730

Tämän organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwalts-gesellschaft

Rekisterinumero: UStID DE267215971

Postiosoite: Kramergasse 4

Postitoimipaikka: Dresden

Postinumero: 01067

Maaryhmittely (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Maa: Saksa

Sähköposti: l.moerchen@eureos.de

Puhelin: +49 39156286912

Tämän organisaation roolit:

Hankintapalvelujen tarjoaja

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Rekisterinumero: 07-0001801100000-05

Postiosoite: Stiftsstraße 9

Postitoimipaikka: Mainz

Postinumero: 55116

Maaryhmittely (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)

Maa: Saksa

Sähköposti: vergabekammer.rlp@mwwlw.rlp.de

Puhelin: +49 6131162234

Tämän organisaation roolit:

8.1. ORG-0004

Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83

Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53119

Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Maa: Saksa

Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Puhelin: +49228996100

Tämän organisaation roolit:

TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: c6abad07-e17d-4e42-b1fc-35d01bf3fcf6 - 01

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä

Ilmoituksen alatyypin: 16

Ilmoituksen lähetyspäivä: 15/07/2026 17:22:32 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

Ilmoituksen julkaisunumero: 497413-2026

EUVL S -lehden numero: 136/2026

Julkaisupäivä: 17/07/2026